

開示の要約

基板処理装置

- 5 表面処理された基板を速やかに洗浄モジュールまで搬送することができる基板処理装置が開示される。基板処理装置は、基板を処理するための処理ユニットと、処理ユニットの間で基板を搬送する中継搬送装置を備える。処理ユニットのそれぞれは、表面処理モジュールと、洗浄モジュールと、乾燥モジュールと、各処理ユニットの一方側から反対側まで延びる基板搬送装置と、基板を基板搬送装置から表面処理モジュールに、表面
- 10 処理モジュールから洗浄モジュールに搬送する処理搬送装置を備える。

図 1